高周波基板バイアススパッタ法により転移温度を低下させた ZnO/glass 上 VO₂薄膜の光学特性

Optical properties of VO₂ films on ZnO/glass with reduced transition temperature by rf substrate bias sputtering

1東海大院工2産総研○星野 寛明1,福住 達郎1,佐藤 賢太1,沖村 邦雄1,山口 巖2,土屋 哲男2

¹Graduate School of Engineering, Tokai University,

²National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

°Hiroaki Hoshino¹, Tatsuro Fukuzumi¹, Kenta Sato¹, Kunio Okimura¹, Iwao Yamaguchi², and Tetsuo Tsuchiya²

hoshino-hiroaki0203@hotmail.com

二酸化パナジウム(VO₂)は高温時, V 原子が c 軸上に等間隔に位置する正方晶構造(Tetragonal-Rutile, P4₂/mnm)を取るのに対し, 68℃以下の低温領域において, V 原子が c 軸方向に変位し, ジグザグの V-V ペアを有する単斜晶構造(Monoclinic, P2₁/c)へと構造相 転移を生じる.これにより, V の 3d 軌道における電子間の相関効果が発現し,抵抗値や赤外光領域の光透過率の大きな変化を示す 金属-絶縁体相転移が生じる. VO₂ はこの特性を活かし,熱線を自動的に調節するスマートウィンドウなどへの応用が期待されて いる.しかし,構造相転移温度が 68℃と比較的高いことが一つの課題となっている.特定の基板の導入や不純物のドーピングに よって転移温度を室温付近まで下げることは可能であるが,膜厚や基板の制限,転移特性の悪化が問題となる.我々はこれまで rf 基板バイアススパッタ法を用い,単結晶 c-Al₂O₃ 基板上 VO₂ 薄膜において転移温度をシフトさせた[1].しかし,単結晶基板は製造 コストが高いため,大面積基板が要求されるスマートウィンドウへの応用は難しい.そこで Al₂O₃ と同様な六方晶構造をとる酸化 亜鉛(ZnO)に注目した.Kato らは,ZnO をバッファ層として用いることにより,glass 基板上において VO₂ 薄膜が b 軸配向成長する ことを報告した[2].我々は前回 VO₂ が b 軸配向成長する ZnO/glass 基板上において rf 基板バイアススパッタ法を用い,VO₂ 薄膜の 転移温度の低温化に成功した.今回はスマートウィンドウへの応用を目指し,光学的特性について詳細に検討したので報告する.

V 金属ターゲット(99.9%)を用い, rf 基板バイアス印加反応性スパッタ法 によって, VO2 薄膜を ZnO/glass 基板上へ堆積した. 基板温度 250℃, ターゲット rf 電力を 200 W と一定とし, 酸素流量比を酸素が過剰状態となるように調整した. 基板にバイアスを印加するため, 50×50 mm²の V 金属板をヒータ上に設置し, 基板バイアス電力を 0~40 W と変化させた.

基板バイアス電力を0~40Wの範囲で印加すると、負の自己バイアス電圧の絶対値は0~280Vであった.Figure1(a) に自己バ イアス電圧変化時のZnO/glass基板上VO2薄膜の300~2500 nmにおける透過スペクトルを示す.基板バイアス電圧0VではVO2 が成長していないため、30、85℃共に同様の透過特性を示した.自己バイアス電圧-100~-280Vのサンプルにおいては赤外光領域 の透過率は温度上昇時に大きく低下した.Figure1(b) に波長2.5 µmにおける温度-透過率特性を示す.自己バイアス電圧の増加に 伴い転移特性が室温方向へシフトを示した.また、-220Vのサンプルまでは透過率の変化幅が50%と大きな変化を保って転移温 度シフトが実現された.本発表では、ラマン分光測定の結果や分光測定の結果から求めた VO2 薄膜のバンドギャップなどの光学 特性について述べる.



[1] N. H. Azhan, K. Su, K. Okimura, and J. Sakai, J. Appl. Phys. 117, 185307 (2015). [2] K. Kato, P. K. Song, H. Odaka, and Y. Shigesato, Jpn. J. Appl. Phys. 42, 6523 (2003).

